

## DSF-K800

- “輪郭形状”と“表面粗さ”をワンスキャンで同時測定が可能
- より高度な解析機能、プラトー表面解析ソフトと接触点フィルタを標準装備
- 移動速度の向上 上下左右の移動速度を大幅にUP
- 検出器過負荷停止機能標準装備

- “Contour (form)” and “surface roughness” can be measured by one scanning
- With Plateau surface analyzing software and Morphological contact-point filter
- Improved the positioning speed
- Equipped with pick-up overload halt function as standard

## 仕様 | SPECIFICATION |

Z 最大測定範囲	Z Max measuring range	5 mm/8 mm
	SA-41/SA-32	
X 最大測定距離	X Max measuring range	100 mm
Z 最小分解能	Z Min resolution	7.5 nm/12 nm
真直度	Straightness	0.4 μm/100 mm
検出器	Pick-up	PU-FK1A
触針	Stylus	SA-41/SA-32
		R2 μm 60°/R25 μm 25°
設置寸法	Installation size	W1500 mm×D800 mm



## DSF-L800

- 変位検出にデジタルセンサを組み込み、“輪郭形状”と“表面粗さ”をワンスキャンで同時測定が可能
- より高度な解析機能、プラトー表面解析ソフトと接触点フィルタを標準装備
- 移動速度の向上 上下左右の移動速度を大幅にUP
- 検出器過負荷停止機能標準装備

- “Contour(form)” and “Surface roughness” can be measured by one scanning with the Digital sensor
- With Plateau surface analyzing software and Morphological contact-point filter
- Improved the positioning speed
- Equipped with pick-up overload halt function as standard

## 仕様 | SPECIFICATION |

Z 最大測定範囲	Z Max measuring range	12 mm/24 mm
	SA-41/SA-32	
X 最大測定距離	X Max measuring range	100 mm
Z 最小分解能	Z Min resolution	0.75 nm/1.5 nm
真直度	Straightness	0.4 μm/100 mm
検出器	Pick-up	PU-LA4
触針	Stylus	SA-41/SA-32
		R2 μm 60°/R25 μm 25°
設置寸法	Installation size	W1500 mm×D800 mm

